

最近公開された出願特許

2017年12月1日～2018年12月31日

特開 2018-187664	アフターシールド治具及び溶接システム	特開 2018-145080	カーボンナノチューブの製造方法、カーボンナノチューブ、及び配向カーボンナノチューブ付き基材
特開 2018-186252	エピタキシャル成長装置及びエピタキシャル成長方法	特開 2018-137400	化合物半導体の製造方法
特開 2018-186228	堆積物の除去方法、及び堆積物の除去装置	特開 2018-135239	二酸化塩素ガスの製造方法
特開 2018-184634	積層構造物の製造方法	特開 2018-132109	水素ステーション
特開 2018-184319	炭素系微細構造物、及び炭素系微細構造物の製造方法	特開 2018-127657	銅微粒子及びその製造方法、並びに焼結体
特開 2018-177615	水素ガス製造装置、及び水素ガス製造方法	特開 2018-123878	液化ガス供給方法
特開 2018-177567	水素ガス精製装置、及び水素ガス精製装置の運転方法	特開 2018-123877	液化ガス供給方法
特開 2018-173226	バーナ及びバーナの運転方法、並びに冷鉄源の溶解・精錬方法	特開 2018-119896	液面測定方法
特開 2018-173211	凍結装置	特開 2018-118893	熱回収型酸素窒素供給システム
特開 2018-172708	浸炭装置	特開 2018-117005	気相成長装置
特開 2018-172707	浸炭装置	特開 2018-103156	排ガス処理用カラム、排ガス処理装置及び排ガス処理方法
特開 2018-169209	ニッケルカルボニル分析装置、及びニッケルカルボニルの分析方法	特開 2018-090480	窒素及び酸素の製造方法
特開 2018-169051	空気分離方法、及び空気分離装置	特開 2018-090479	窒素及び酸素の製造方法及び製造システム
特開 2018-168890	水素充填方法及び水素充填システム	特開 2018-087119	酸素除去方法及び酸素除去装置
特開 2018-167299	ガス切断装置	特開 2018-085436	ヒドラジン類ガスの供給方法及び装置
特開 2018-164884	一酸化炭素安定同位体濃縮装置および一酸化炭素安定同位体濃縮方法	特開 2018-083731	ヘリウムガス回収供給システム
特開 2018-163089	水素分析装置、及び水素の分析方法	特開 2018-082825	カニューラ及びカニューラ用チューブ
特開 2018-162484	水素混合ガス生成装置、及び水素混合ガスの生成方法	特開 2018-079486	溶接用トーチ及びワイヤー狙いガイド
特開 2018-162475	浸炭炉の運転方法	特開 2018-076893	水素充填方法、水素充填システム、及び制御プログラム
特開 2018-162474	銅微粒子、銅微粒子の製造方法、及び焼結体の製造方法	特開 2018-070425	カーボンナノチューブ分散液
特開 2018-161605	ガス精製方法及び装置	特開 2018-070045	温度コントロールベースプレート
特開 2018-159441	可搬式超低温液化ガス容器、及び把持規制部材	特開 2018-066511	ターボ冷凍機
特開 2018-158596	宇宙環境試験装置の温度制御方法および宇宙環境試験装置	特開 2018-066390	ガス充填方法及びガス充填設備
特開 2018-154357	凍結保存容器	特開 2018-065067	液滴製造装置および液滴製造方法
特開 2018-151149	ガス冷却システム	特開 2018-062479	モノメチルヒドラジンガスの精製方法
特開 2018-151131	被加熱物の加熱方法及び加熱装置	特開 2018-054420	凍結保存器具
特開 2018-151043	水素ステーションの水素充填方法	特開 2018-054141	低温冷却装置
特開 2018-149509	酸化エチレン除去方法	特開 2018-052773	微粒子の製造方法、及び微粒子
特開 2018-149508	酸化エチレン除去方法	特開 2018-051501	吸着塔
特開 2018-146334	同位体濃度測定装置、及び同位体濃度の測定方法	特開 2018-048787	液体用バッグの急速凍結方法および急速凍結装置
特開 2018-145471	浸炭用雰囲気ガスの生成方法	特開 2018-047085	液体用バッグの急速凍結用容器
		特開 2018-046044	サセプタのクリーニング装置及びクリーニング方法
		特開 2018-044738	バーナ
		特開 2018-041883	気相成長装置用部品の洗浄方法
		特開 2018-037571	窒化物半導体製造装置の洗浄方法
		特開 2018-036066	分注装置及び分注方法

最近公開された出願特許

2017年12月1日～2018年12月31日

特開 2018-034191	ガス切断用燃料ガス、及びガス切断方法
特開 2018-032429	高圧ガス発注システム、発注方法及びコンピュータプログラム
特開 2018-031996	高導電性・高離型性・高耐摩耗性部材及び定着装置
特開 2018-031539	スラリーアイス製造方法
特開 2018-031530	粒状凍結物製造装置及び粒状凍結物製造方法
特開 2018-031436	霜付防止装置及び霜付防止方法
特開 2018-027571	ワイヤー狙いガイド及び溶接装置
特開 2018-025341	ポストミックス水素用火口及び水素ガス切断方法
特開 2018-021807	同位体濃度分析装置および同位体濃度分析方法
特開 2018-021594	バイオネット継手
特開 2018-017650	ガス濃度検出ユニット及びガス濃度測定方法
特開 2018-013292	排ガス処理方法、排ガス処理装置及び炭素繊維製造システム
特開 2018-012871	接合材、接合材の製造方法、及び接合体
特開 2018-003972	高圧ガス用圧力放出弁
特開 2018-003088	接合材、接合材の製造方法、及び接合体
特開 2017-223547	多重反射セル
特開 2017-221901	多重反射セル
特開 2017-221591	うつ病治療薬供給装置
特開 2017-219522	液面検出器、凍結保存容器、および液面検出方法
特開 2017-219246	回転機械
特開 2017-213966	宇宙環境試験装置の支持脚構造
WO17/057400	ガス供給装置、混合機能付きガス供給装置、溶接装置、及びガス供給方法

計 89 件